

Structura resursei umane de Cercetare-Dezvoltare

1. Total personal

Anul	Nr.
Cercetători științifici gradul I	17
Cercetători științifici gradul II	9
Cercetători științifici gradul III	24
Cercetători științifici	12
Asistenți de cercetare	8
Inginer de dezvoltare tehnologica gradul I	2
Inginer de dezvoltare tehnologica gradul II	1
Total personal de cercetare atestat	73
Personal auxiliar neatestat care lucrează în cercetare*	56
Total personal de cercetare care realizează venituri din activitatea de cercetare-dezvoltare	129
Doctori în știință:	35
Conducători de doctorat	1

Numărul de personal de cercetare-dezvoltare: 73

* Personalul auxiliar de cercetare, neatestat, care desfășoară activități în domeniul tehnologic - INCD pentru Microtehnologie fiind singurul institut tehnologic, care deține camere curate, specifice activității în microelectronica, micro si nanotehnologii- (inclusiv întreținerea bazei de date și a rețelei): **56 din care 33 cu studii superioare (incluzând 4 ACD, fără master) și 23 tehnicieni.**

2. Informații privind activitatea de perfecționare a resursei umane (personal implicat în procesele de formare – stagii de pregătire, cursuri de perfecționare)

1. Stagii de pregătire post-doctorale 3
2. Număr de masteranzi : 3
3. Număr de doctoranzi: 17
4. Număr de teze de doctorat realizate în 2009: 2
5. Participare la scoli de vara: 4
6. Participare la cursuri de perfecționare: 6
7. Alte forme de perfecționare: training pentru utilizarea echipamentelor: 11

CURSURI, STAGII DE PREGATIRE SI SCOLI DE VARA

Cursuri de Master ale Facultății de Electronica, Telecomunicații și Tehnologia Informației -, Universitatea "Politehnica" București, începând din octombrie 2009 - desfășurate în IMT (cu acces la facilitățile experimentale din zona "Gri").

- **Microsisteme și senzori inteligenți;**
- **Micro- și Nanotehnologii pentru aplicații în medicina.**

Programe postdoctorale: Program postdoctoral în RF MEMS și MOEMS finanțat din proiectul european FP7, Contract no. 202897, REGPOT call 2007-1, cu acronimul MIMOMEMS: Alexandra Stefanescu, Mihaela Carp, Emil- Mihai Pavelescu.

Scoli de vara

1. "MicroOptics" EU FP6 Marie Curie Training Courses program- 22 iunie - 4 iulie 2009 - **Rodica Voicu**

2. "Micro Mechanical System Design and Manufacturing", 14 – 27 iunie 2009, Universitatea Tehnica din Danemarca (DTU), Copenhaga, Danemarca; **Bogdan Firtat**
3. "New frontiers in optical technologies", Tampere TUT, Finlanda, 8-15 august 2009; **Florin Comanescu**
4. "Summer School on Nanomedicine", Cascais, Portugalia, 12 – 16 iunie 2009; **Roxana Vasilco**

Cursuri de instruire

1. Curs „Nanotechnology for Electronics in Bucharest. The second module of the Eurotraining course "Nanotechnology for electronics" 16-17 noiembrie 2009 ; **Alexandra Stefanescu, Dan Vasilache, Marian Ion, Florin Comanescu**
2. "School of SIESTA", Curs teoretic si practic pentru utilizarea programul academic SIESTA, specializat pe calcule de mecanica si transport cuantic la nivel cristalin si molecular, Centrul de Supercomputing Catalunya, Barcelona, Spania, 18-23 mai 2009; **Radu Popa**
3. Participare la Cursul pentru utilizarea programului de calcul FPLO-08, "DFT meets Solid State Chemistry & 8th Tutorial Hands-on-FPLO" , Organizator Institutul Max Plank pentru Chimie Fizica a Solidelor (Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids-MPI CPFS) din Dresda, Germania; 25-30 octombrie 2009, Dresda, Germania: **Rodica Plugaru**

Stagii de pregătire

1. Instruire utilizare echipament 3D printer Formiga P100 organizat de EOS GmbH, Germany in IMT-Bucuresti; 29 iunie- 2 iulie 2009; **George Boldeiu, Victor Moagar-Poladian**
2. Instruire utilizare echipament Scanning Near-field Optical Microscope (SNOM) 9 Iulie 2009, Ulm; **Cristian Kusko, Roxana Rebigan**
3. Instruire utilizare echipament AFM Ntegra (organizat de firma NT-MDT) Brasov, mai 2009; **Raluca Gavrilă**
4. Instruire utilizare echipament NanoIndenter G200- Testworks Explorer Training (organizat de Agilent Technologies), IMT- București, aprilie 2009; **Raluca Gavrilă, Laura Eftime, Catalin Tibeica**
5. Instruire utilizare echipament Rigaku SmartLab System, Japonia, aprilie 2009; **Mihai Danila**
6. **Training** pentru utilizarea echipamentului SUSS MA6 Mask Aligner, **organizat de** Suss MicroTec Lithography GmbH in Garching, Germany, 10-14 Aug. 2009, **Catalin Parvulescu, Vasile Dumitrescu**

Total: Stagii de pregătire pentru 21 de persoane